

2025年度 大阪大学 ARIM 技術セミナー

初心者からプロまで！ 電子ビーム描画装置の活用法

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）は、令和3年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の一環として、装置メーカーによる技術セミナー『微細加工・電子ビーム露光技術』を2025年5月14日（水）に開催いたします。

最先端の自動搬送型超高精細電子ビーム描画装置の構成や実際に用いた微細加工の原理と考え方、露光条件の検討手法についてご紹介いたします。

産学官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしております。

◇講演

【日時】 2025年5月14日（水） 10:00～15:00

【参加費】 無料

【定員】 6名（先着順，参加登録をお願いします）

【オンライン定員】 100名（先着順，参加登録をお願いします）

【お申込み】 <https://forms.office.com/r/xyFRHZ9Ugq?origin=IprLink>

【お申込み締め切り】 2025年5月12日(月)



◇講演プログラム

10:00-10:05 はじめに

大阪大学 産業科学研究所 岡本 稔

10:05-11:30 『描画装置の基礎講座』

株式会社エリオニクス 国内営業本部 杉原 達記

13:00-15:00 『実機演習&質疑応答』

株式会社エリオニクス 国内営業本部 杉原 達記

*ご参加者様より電子ビーム描画プロセスなど微細加工に関するご質問、課題について自由に御相談頂けます。

【主催】 大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）

【共催】 株式会社エリオニクス

お問い合わせ

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）事務局

E-mail : info-nanoplat@sanken.osaka-u.ac.jp